

## HS1500G

### 1500°C高温 气密腔

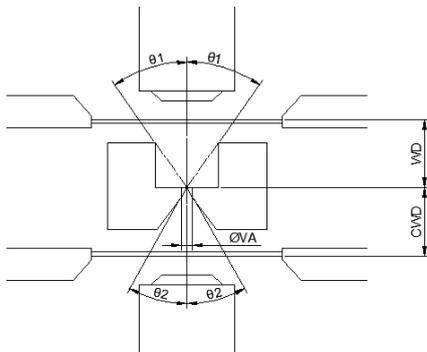
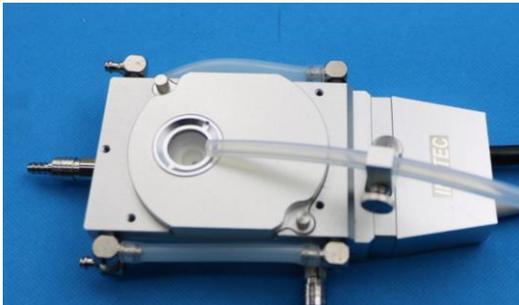


### 功能特点

- 适用于 显微镜/光谱仪 的超高温应用
- 30°C~1200°C 可编程控温
- Φ8 mm 加热区
- 样品区-视窗 偏心设计, 可旋转窗片移开高温挥发物
- 可充入保护气体的气密腔
- 可从温控器或电脑软件控制, 可提供软件 SDK
- \*可做定制或改动, 详询上海恒商

### 增高盖

- 适用于 红外设备 的超高温应用
- 增加加热区与红外玻璃距离, 防止损坏



### 产品简介

HS1500G 高温热台专为显微镜/光谱仪上的超高温应用设计, 可用于陶瓷、冶金、地质、高温材料等领域。可加装样品接电引线, 可定制样品区。

此款冷热台可在 30°C ~ 1500°C 范围内控温, 同时允许光学观察和样品气体环境控制。热台窗盖与台体构成一个气密腔, 且样品区偏离视窗中心, 这样即可以充入氮气等保护气体, 来防止样品高温下反应, 又可以通过旋转窗片来移开窗片上的挥发物。

### 温控参数

温度范围	30°C ~ 1500°C
加热块材质	耐高温陶瓷
传感器/温控方式	S 型热电偶 / PID 控制
最大加热/制冷速度	+200°C/min (<850°C时); +20°C/min (>850°C时)
最小加热/制冷速度	±0.5°C/min
温度分辨率	0.1°C
温度稳定性	±1°C
软件功能	可设温控速率, 可设温控程序, 可记录温控曲线

### 光学参数

适用光路	透射光路 和 反射光路
窗片	可拆卸与更替的窗片
最小物镜工作距离	6.3 mm (标准) 11.7 mm (增高盖) *截面图中 WD
最小聚光镜工作距离	11.75 mm *截面图中 CWD
透光孔	Φ2 mm *截面图中ΦVA
上盖窗片观察	窗片范围 Φ28mm, 最大视角±45°(标准) 窗片范围 Φ16mm, 最大视角±34°(增高盖) *截面图中θ1
底部窗片观察	最大视角±21.6° *截面图中θ2
高温下显微镜降温	吹气降温

### 结构参数

加热区/样品区	Φ8 mm
样品腔高	3.5 mm
	*样品最大厚度 = 样品腔高 - 样品衬底厚度
样品衬底	默认为石英坩埚 (Φ6 mmx1 mm)
上盖	可调压力的窗盖, 兼顾气密型与窗片旋转
气氛控制	气密腔, 可充入保护气体
外壳冷却	通循环水, 以维持外壳温度在常温附近
安装方式	水平安装 或 垂直安装
台体尺寸/重量	141 mm x 62 mm x 25.3 mm / 1350g

### 配置列表

基本配置	HS1500G 高温热台、mK2000B 温控器、外壳循环水冷却系统
可选配件	冷热台安装支架、真空系统 (仅用于真空型号)、样品接电引线

## 温控配件系列

### 用于 Instec 温控装置

#### 适用范围

用于搭配 Instec 冷热台、Instec 温控探针台、Instec 温控晶圆夹盘、Instec 冷热平板、Instec 定制温控装置使用。

#### 温控配件系列

安装支架：用于将温控装置固定在用户设备上  
mK2000B 温控器，含 InstecAPP 温控软件，温控装置必选  
外壳循环水冷系统，帕尔贴式温控装置必选  
MITO 系列温控联用显微镜相机，含控制软件  
LWDC2 长工作距离聚光镜  
真空系统：包括真空泵+真空管路，用于真空型温控装置

#### 外壳循环水冷系统

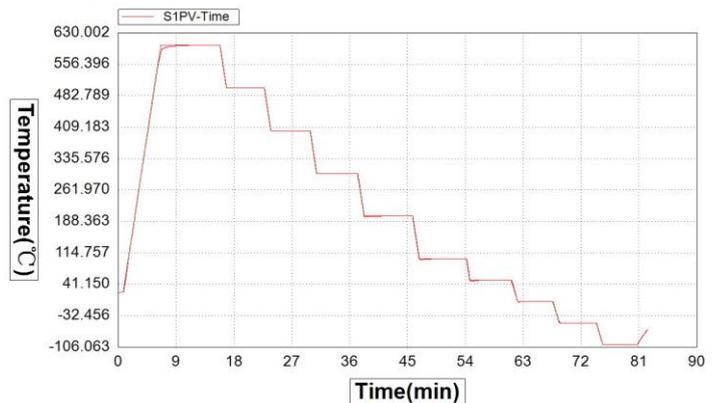
用于温控装置的外壳/底座的冷却。温控装置加热/制冷时，外壳/底座温度会被带得很烫/很凉，危害周遭人员设备甚至设备自身。用循环水让外壳温度保持在常温附近，能有效预防此灾害。



#### mK2000B 温控器

支持恒温、恒速率变温、暂停、编程温控功能。具有冷热独立的多段 PID 控制、可保存 4 套 20 段校准表等特点。可独立控制，也可从 InstecAPP 软件控制。

温度分辨率	±0.001°C (热敏电阻), ±0.01°C (RTD), ±0.1°C (热电偶)
控制接口	USB 虚拟串口 可选其他接口
可选项	LVDC 线性可调直流电源, 用于降低电噪音
温控软件	InstecAPP, 可提供多语言 SDK



#### 安装支架

针对用户设备定制，可让热台水平固定/垂直固定等，垂直光路/水平光路等的用户设备皆可适用。通常有：

- 圆环式（用于圆形载物台）、平板式（用于方形载物台）、
- 载物台式（用于代替设备载物台）、立式（用于水平光路）。

